

光導波路製造プロセスにアルバック独自のソリューションを提供



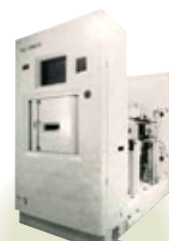
グラッド・コア成膜
CME-200



アニール装置
V6-100



メタルマスク成膜
SME-200



マスクエッチング
NE-5500



フォトリジストストリッピング
Enviro



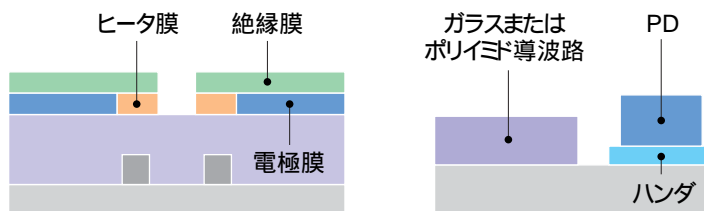
石英用エッチング
NLD-6000



上部グラッド成膜
CME-200

電極、ヒータ、ハンダ部形成

ULVAC Process Solutions



電極やハンダ、ヒータ膜形成
 スパッタ装置SVシリーズ
 蒸着EX、EBXシリーズ



ヒータ成膜・電極成膜
 SV-4540



ハンダ蒸着・電極成膜
 EBX-1000

株式会社アルバック

標準化された装置をお使い下さい

PE-CVD
 CME-200

スパッタ装置
 SME-200

エッチング装置
 NLD-6000



株式会社アルバック

省スペース、低価格を実現したカセットtoカセット方式の装置です。

3～8インチ基板サイズに対応可能(オプションにより、不定形、角型基板に対応可能)

制御系には、アルバックが開発したGPCS(タッチパネルコンピュータ+シーケンサー)を採用しています。

カセット室、搬送室、搬送ロボット等、装置間の共通化を図っております。